

График загрузки оборудования ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ

Оборудование	Планируемая/фактическая загрузка оборудования ЦКП на апрель 2017 года																														Итого	% исп.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Сканирующий зондовый микроскоп Solver Pro-M (НТ-МДТ)			4	4	4	4				4	4	4					4	4	4	4				4	4	4							56	35
Дериватограф Diamond TG/DTA (PerkinElmer)			6	6	6	6	6			6	6	6	6	6			6	6	6	6	6			6	6	6							108	67,5
Специализированный комплекс получения микро и нанопорошков сегнето- и пьезоматериалов, формирования, синтеза, обжига и измерения параметров исследуемых образцов Пьезо-1			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8					160	100
Электрокамерная печь Nabertherm HT16/16			8	8	8					8	8	8	8				8	8	8	8													88	55
Лабораторная циркуляционная диспергирующая установка ЛЦДУ-3/0,0005-ОК-МНД			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8																			80	50
Комплекс оборудования для литья керамической ленты Кеко			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8					160	100
Комплекс оборудования (для изготовления электронных компонентов LTCC (КЕКО Equipment)			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8					160	100
Специализированный комплекс Кеко Equipment для получения и исследования свойств элементной базы композиционных и керамических сегнетоматериалов			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8					160	100

Газовый хромато-масс-спектрометр GCM-QP2010SE (Shimadzu)			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8					56		
He-Cd лазер IK3501 R-G (Kimmon) в комплекте с блоком питания и измерителем мощности и энергии ES245C PM1 00D			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8					56		
ВСЕГО																												
	- оборудование доступно к использованию																											
	- оборудование занято частично (часов в день)																											
	- оборудование занято полный рабочий день (8 часов)																											
	- оборудование занято круглосуточно (24 часа)																											